

装置と場所の対応表 Equipment and Location Correspondence Table

共通機器センター Shared Research Facilities

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name	
1	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ	X線回折装置 XRD	Ultima IV (Rigaku)	
2		テクノプラザ	X-ray Diffractometer	SmartLab (Rigaku)	
3		テクノプラザ	走査型電子顕微鏡 SEM	汎用SEM 6010LV (JEOL)	
4		テクノプラザ5(01I32室)	Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LV)	
5		テクノプラザ	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM	FE-SEM JSM-7610 (JEOL)	
6		テクノプラザ	Field Emission-type SEM	FE-SEM JSM-7100 (JEOL)	
7		テクノプラザ2*	電子線マイクロアナライザ EPMA	EPMA-8050G(Shimazu)	
8		テクノプラザ	熱重量示差熱分析装置 TG-DTA	TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)	
9			精密熱重量ガス分析装置 TG-MS	TG5500 SI(ティ・エイ・インスツルメント) & GSD350(PFIFFER VACUUM)	
10			レーザー顕微鏡	OLS4000 (Olympus)-1	
11			Laser Microscope	OLS4000 (Olympus)-2	
12			デジタルマイクロスコープ	VH-Z100UR (KEYENCE)	
13			プローブ顕微鏡	汎用AFM AFM5000 II (HITACHI)	
14			Probe Microscope	高機能AFM SPM8000-FM (Shimazu)	
15			光学顕微鏡	BX51(Olympus)	
16			引張圧縮試験機	AG-50kNX (Shimazu)	
17			ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム	DelsaMax PRO(BECKMAN COUTER)	
18			テクノプラザ2*	顕微ラマン分光装置	LabRAM HR Evolution(HORIBA)
19			分析解析センター3 12F30	分光エリプソメーター	RC2-DI-SUY(J.A.Woollam社 ジェー・イー・ウーラム・ジャパン)
20			テクノプラザ	フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR	IRAffinity-1S(Shimazu)
21				顕微フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR	FT-IR-4X + IRT-5200 (Jasco)
22		紫外可視分光光度計		V630-BIO (Jasco)	
23		UV-Vis Spectrophotometer		テラヘルツ分光光度計	
24		Terahertz Spectrophotometer		VIR-F (Jasco)	
25		紫外可視赤外分光光度計		UV-3600 Plus(Shimazu)	
26		分析解析センター3 12F30	分光蛍光光度計	FP-750 (Jasco)	
27		テクノプラザ	Spectrofluoro-Photometer		
28		テクノプラザ2*	X線CTスキャン	μ Ray8700(Matsusada)	
29		テクノプラザ	X-ray CT Scan		
30		テクノプラザ2*	スパッタリング装置	CFS-4ES II (SHIBAURA MECHATRONICS)	
31		テクノプラザ	Sputtering Equipment		
32		テクノプラザ	サーマルマネキン	TM8-22R (PT-Teknik)	
33		テクノプラザ	Thermal mannequin		
34		分析解析センター3 12F30	自動接触角測定装置	OCA15EC (Dataphysics Instruments GmbH)	
35		分析解析センター3 12F30	Contact angle measuring device		
36		分析解析センター3 12F30	窒素吸着比表面積細孔分布測定装置	Belsorp II mini (MicrotracBEL Corp.)	
37		分析解析センター3 12F30	Adsorption Measurement		
38		09I25 クリーンルーム	マスクレス露光装置	DL-1000GS/SS (NanoSystem, 9Fクリーンルーム)	
39		分析解析センター3 12F30	Maskless Lithography System		
40		分析解析センター3 12F30	偏光ゼーマン原子吸光度計	Z-2300 (HITACHI)	
41		分析解析センター3 12F30	Polarized Zeeman atomic absorption spectrophotometer		
42		13G27-b	質量分析計	AXIMA-CFR+(plus) (SHIMADZU)	
43		分析解析センター3 12F30	Mass Spectrometer		
44		分析解析センター3 12F30	大気圧イオン化高分解能飛行時間型質量分析計	JMS-T100LP (JEOL)	
45		分析解析センター3 12F30	Mass Spectrometer		
46	分析解析センター3 12F30	円二色性分散計	J-820 (JASCO)		
47	分析解析センター3 12F30	Circular dichroism spectrometer			
48	分析解析センター2 11B27	2次元印刷装置(フードプリンター)	MMP-F13S (Mastermind)		
49	分析解析センター2 11B27	Food Printer			
50	テクノプラザ5(01I32室)	核磁気共鳴装置	JNM-ECZL400R (JEOL)		
51	テクノプラザ5(01I32室)	Nuclear Magnetic Resonance, NMR			
52	テクノプラザ2*	真空加熱蒸着装置	SVC-700T (SANYU ELECTRON)		
53	テクノプラザ2*	Vacuum Evaporation System			
54	テクノプラザ2*	電子ビーム蒸着装置	SVC-700LEB (SANYU ELECTRON)		
55	テクノプラザ2*	Electron Beam Evaporation System			
56	テクノプラザ2*	シリコン深掘り装置 (Deep RIE)	MUC21 ASE-SRE (SPP technologies)		
57	テクノプラザ2*	Silicon Deep Reactive Ion Etching Machine			
58	テクノプラザ2*	スピンドーター	ACT-300A II (株式会社アクティブ)		
59	テクノプラザ2*	Spin Coater			
60	テクノプラザ2*	プラズマ微細加工装置	TEP-01x(立山マシン株式会社)		
61	テクノプラザ2*	Plasma microfabrication equipment			
62	テクノプラザ2*	その他MEMS関連装置群(スピンドーター、ホットプレート、乾燥器等) Spin Coater etc. for MEMS	-		
63	テクノプラザ5(01I32室)	小型無冷媒型 PPMS	VersaLab TM (Quantum Design)		
64	分析解析センター3 12F30	半導体パラメータアナライザ	4156B(Hewlett packard)		

46	テクノプラザ2*	テクノプラザ2*	手動回転研磨機 Rotary Polishing Machine	LaboPol-30 (Struers)	
47		テクノプラザ	アクティブラーニングスペース Active Learning Space	打ち合わせスペース Meeting space	
48			テクノ工房 Techno Studio		
49			低速切断機アインメット Low speed cutting machine	Isomet (Buehler)	
50			恒温振とう培養器 Homeothermic shaking incubator	BR-11FP (タイテック)	
51			小型電気炉 Small electric furnace	HPM-1N (As one)	
52			小型熱プレス機 Small heat press machine	AH-2003 (As one)	
53			テクノプラザ4	レーザー加工機 大型(A1サイズまで) Laser cutting machine	Speedy400 (Trotec Laser) 100W
54				レーザー加工機 小型(A3サイズまで) Laser cutting machine	Rayjet 50 (Trotec Laser)
55		樹脂用簡易CNC切削機		MODELA model MDX-40 (ローランド ディージー)	
56		熱溶融積層型3Dプリンタ Fused Deposition Modeling 3D Printer		Ender 3 S1 Pro (Creality)	
57		101-2	走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LA)	
58			透過型電子顕微鏡TEM TEM (Transmission Electron Microscope)	JEM-2100 (JEOL)	
59		202	(新)集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	MI-4050 (日立ハイテック)	
60			(旧)集束イオンビーム加工装置 FIB (Focused Ion Beam)	FB-2000A (日立ハイテクノロジー)	
61			X線回折装置 XRD (X-ray Diffractometer)	SmartLab (Rigaku) Rintの置き換えです	
62			単結晶X線構造解析装置 Single-Crystal Xray Diffraction	D8 QUEST (ブルカー・ジャパン)	
63			窒素水蒸気吸着比表面積測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp MaxII (MicrotracBEL Corp.)	
64			真空蒸着装置 Vacuum Evaporation System	JEE-400 (JEOL)	
65			ウルトラミクロトーム Ultra microtome	EM-ULTRACUT UCT (ライカ)	
66	精密研磨装置 Polisher		ダイヤラップML-150P (マルトー)		
67	マニュアルプローバー Manual prober		705B (日本マイクロニクス)		
68	ピコ秒蛍光寿命測定装置 C11200 (浜松ホトニクス)				
69	絶対PL量子収率測定装置 C9920-02G (浜松ホトニクス)				
70	半導体パラメータアナライザ 4145B (Hewlett packard)				
71	101-1	超純水製造装置 Ultrapure water production equipment	Direct-Q UV (ミリポア)		
72		光学顕微鏡 Optical microscope	LV100D-U (ニコン)		
73		ナノインプリント装置 Nanoimprint equipment	LTNIP-5000 (リソテック)		
74		超臨界乾燥装置 Supercritical dryer	SCRD4 (レクザム)		
75		熱処理装置 Heat treatment equipment	GFA430VN (サーモ理工)		
76		無電解メッキ装置 Electroless metal plating equipment	* (山本鍍金試験器)		
77		スピンコーター Spin coater	ACT-300A II (アクティブ)		
78		膜厚計測装置 Film thickness measuring device	FE-300 (大塚電子)		
79		超音波ホモジナイザー Ultrasonic homogenizer	UP-50H (ヒールツィヤー)		
80		104	プロトンビームライター PBW (Proton Beam Writer)	MBS-1000 (神戸製鋼所)	
81	104-1	電子スピン共鳴装置 Electron Spin Resonance Spectrometer	JES-X310 (JEOL)		
82	105	超伝導量子干渉磁束計 SQUID Superconducting quantum interference device	MPMS-XL (日本カンタムデザイン)		
83	107	核磁気共鳴装置 NMR (Nuclear Magnetic Resonance)	JNM-ECZL400R (JEOL)		
84	301	LC-MS (高速液体クロマトグラフィー-QTRAP 型質量分析装置) Liquid chromatography mass spectrometer	QTRAP® 5500 LC-MS/MS (AB Sciex Pte. Ltd.)		
85	301	セルソーター (フローサイトメーター) Cell Sorter	BD FACSAria III (日本ベクトン・ディッキンソン)		
86	303	放電プラズマ焼結 (SPS) 装置 Spark plasma sintering equipment	LABOX-210 (シンターランド)		

*テクノプラザ2とは、交流棟1階 テクノプラザ3室隣の部屋です。
Technoplaza 2 is located next to Technoplaza3 on the first floor of Kouryu-bulding.

ものづくりセンター Manufacturing Center

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name
87			立形マシニングセンタ Vertical Machining Center	MB-46VA (オークマ)
88			射出成形機 Injection Molding Machine	NPX7-1F (日精樹脂工業株)

89	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ3	バンドソー、コンターマシン Contour machine	NCC-300LE(ニコテック)
90			ファインカッター高速切断機 High-speed cutting machine	HS45A型Cタイプ(平和テクニカ)
91			CNCワイヤー放電加工機 CNC wire electric discharge machine	VL400Q(ソディック)
92			卓上フライス盤 Bench type milling machine	YS300MT(東和精機)
93			卓上旋盤 Bench lathe	YS550V(東和精機)
94			油圧プレス(5t) Hydraulic press	HYP-505H(JAM)
95			ビッカース硬さ試験機 Hardness testing machine	アカシ(ミットヨ)
96			オートグラフ Universal testing machine	AG-20kNG(島津製作所)
97			ベンチグラインダ Bench grinder	FG255T(YODOGAWA)
98			圧入機 Press fitting machine	渡辺機械
99	バンドソー Band Saw	K-100(ホーザン)		
100	ボール盤 Drilling machine	TB131(マキタ) DP3050R(REXON)		
101	大宮校舎 Omiya campus	4号館4102室	マシニングセンタ	V33i(MAKINO)
102			ターニングセンタ	LB3000EX II(okuma)
103			フライス盤	AM103(DMG MORI)
104			フライス盤	NK-1R(IWASHITA)
105			旋盤	MATE-570S(ヤマザキマザック)
106			帯鋸盤	CRA-300(AMADA)
107			コンタマシン	U-500(LUXO)
108			ボール盤	ESD-460(遠州工業)
109	4号館4101室	芝ミル(樹脂&低負荷金属用卓上CNCフライス) ※3台中2台は4101室、1台は豊洲テクノプラザ4に設置	向島テック	
110			卓上旋盤	L5200型S(コスモキカイ)
111			卓上フライス盤	FK-500S(コスモキカイ)
112			卓上ボール盤	大西機械設計
113			バンドソー	BS23(東洋アソシエイツ)
114			ベルトグラインダー	BGM-50(日立工機)